プロセスガス用 圧力センサ

Model: HYZFZW

半導体製造装置用
高耐食ハステロイダイヤフラム

Tem-Tech Lab.

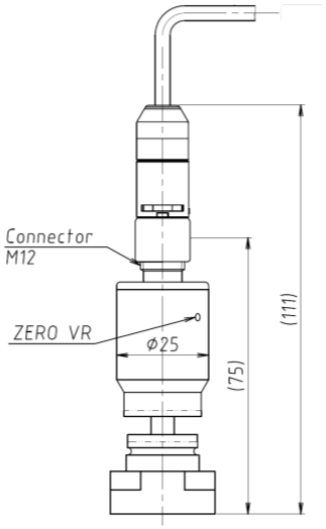


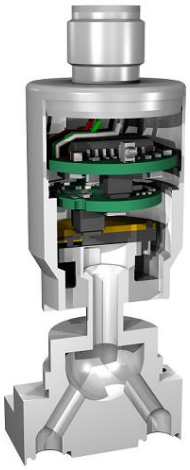
- ✓ **集積型Cシール、Wシールほか各社シールでの販売実績**
- ✓ **ダイヤフラムは耐食性の高いハステロイC-22**
- ✓ **センサー設置時のシール部締め込みによるゼロ値シフトを改善**

- 総合精度±0.2%F.S.の高精度を実現
- 圧力センサー本体にてゼロ調整が可能
- 接ガス部がSUS316L＋ダイヤフラム部ハステロイの高耐食圧力センサー
- ゲージ圧、連成圧ともに製作可能
- 絶縁性の高い圧膜ダイヤフラム構造
- 標準の伝送信号は国際規格の２線式4-20ｍＡ
- ケーブル着脱式採用でメンテナンス時の作業負担が軽減
- 圧力損失が少ない少デッドスペース型構造

プロセスガス用 圧力センサ

Model: HYZFZW





測定流体	半導体プロセスガス
接ガス部材質	ダイヤフラム: ハステロイ(C-22)　センサーボディ: SUS316L
測定範囲	0 (-0.1) ー 0.5、 1MPa
許容限度圧力	定格圧力×2倍
電源電圧	DC24V±10%
出力信号	4～20mADC (2線式)
総合精度	±0.2%FS（直線性・ヒステリシス・再現性含む）
温度補償範囲	0~60℃ (氷結、結露無きこと)
動作温度範囲	0~80℃ (氷結、結露無きこと)
温度特性	±0.05%FS/℃（温度補償範囲内）
保護等級	IP55相当　※屋内仕様
取付けネジ	Cシール、Wシール
ネジサイズ	1.125″
ケーブル取出し	着脱式M12コネクタ
付属ケーブル	3m 標準 (2芯+シールド線)
シール方法	特殊電子ビーム溶接
リーク量	<5×10^{-12}Pam3／sec
内面仕上げ度	Ra: <0.25μm以下

◀ 型式構成標準型式例：*HYZFZW-420XS2*

型式	形状		継手種類		–	アナログ出力		信号コネクタ		継手サイズ	
HYZF	Z	IGS	I	Cシール		420	4-20mA	X	M12コネクタ	S2	1.125"
			W	Wシール							

Tem-Tech Lab.

株式会社　テムテック研究所

本社：〒104-0052 東京都中央区月島 2-7-13
TEL:03-3534-5320 (代表)
FAX:03-3534-5322
大阪営業所：〒582-0026 大阪府柏原市旭ヶ丘2-14-27 #104号
TEL:080-5705-9270

URL: https://www.tem-tech.co.jp　　Email: sales@tem-tech.co.jp (代表)